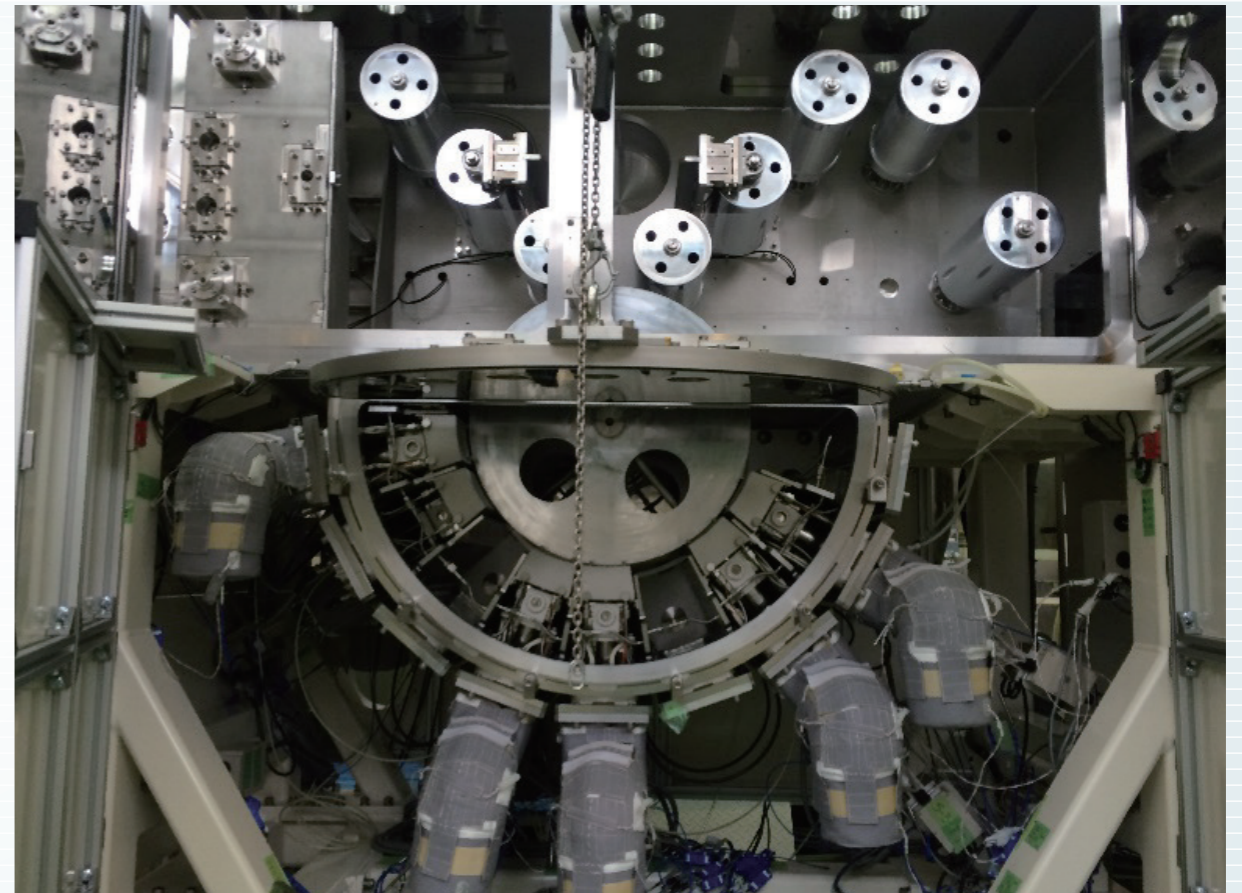
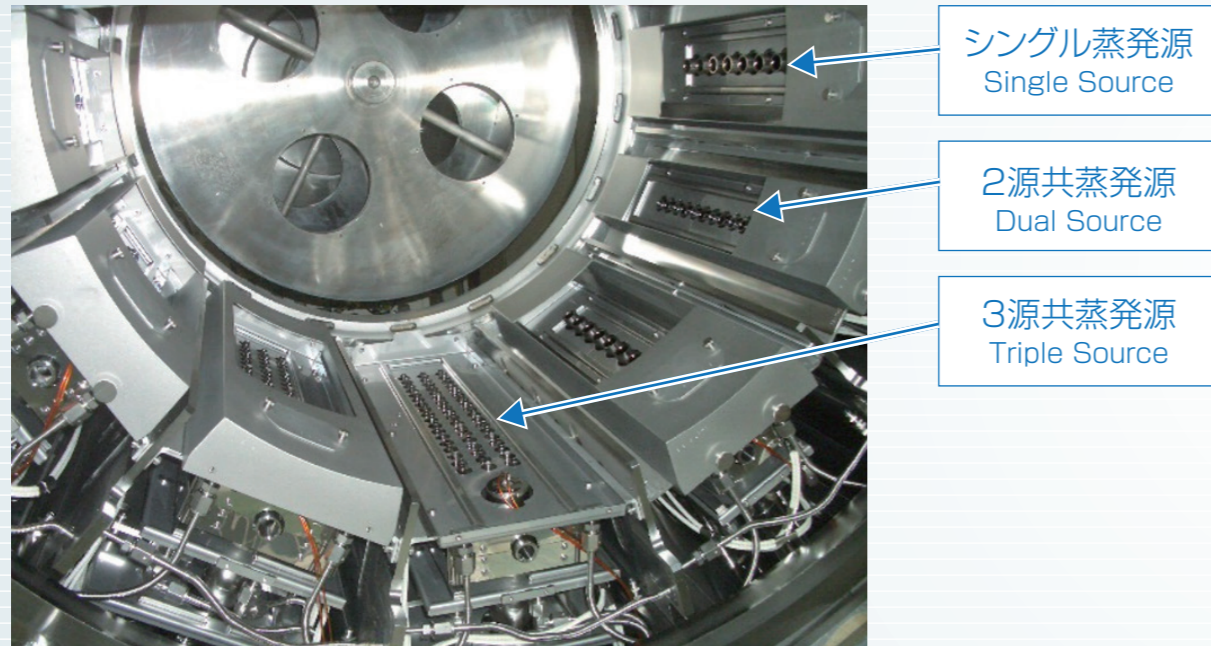


# 面蒸発源転用リニアソース

## Linear Source converted from Planar Source

従来の静止成膜用面蒸発源技術を応用し、連続式蒸着用リニアソースを新たに開発しました。

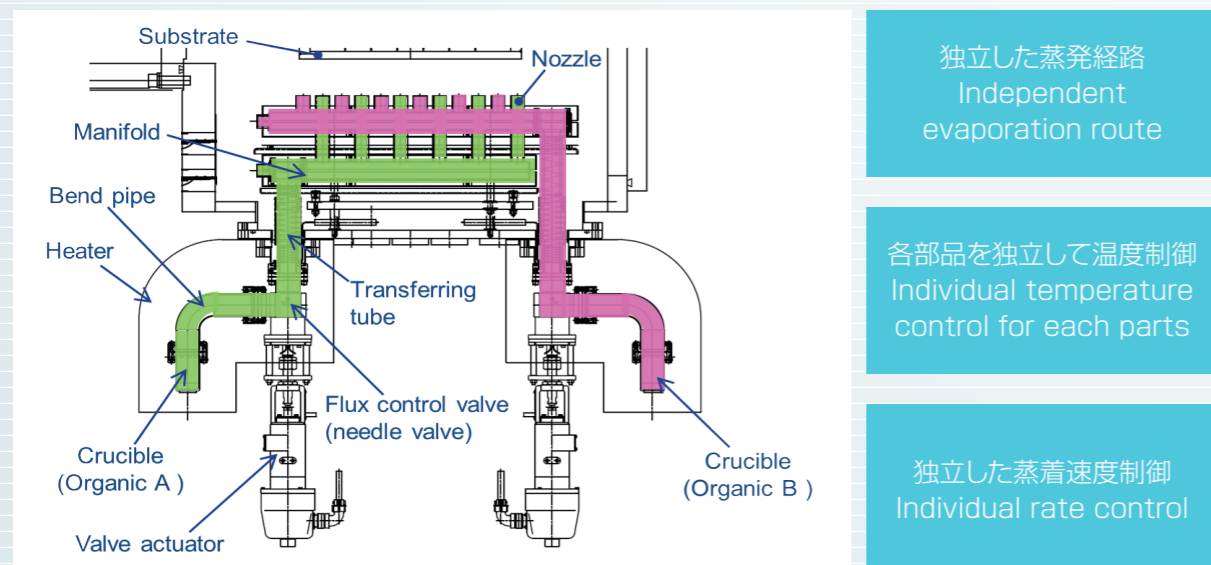
We have developed a linear source for continuous deposition by applying planar source technology for static evaporation.



面蒸発源転用リニアソース 装置外観  
Linear Source converted from Planar Source

### 有機蒸発源構成断面図(2源共蒸着タイプ)

Concept Section Drawing of Organic Source(Dual Source type)



### 特徴 Features

- 有機蒸発源の材料交換機構の搭載 (プロセスチャンバ真空下での交換)  
Equipped Crucible changing mechanism without leakage of the vacuum chamber
- 長寿命の圧力式膜厚計の搭載  
Equipped Pressure type evaporation rate sensor

### 性能 Performance

- バルブ制御により有機材料の材料利用効率 > 60%  
Organic material utilization efficiency for valve control > 60%
- 膜厚均一性の確保  $\leq \pm 3\%$   
High thickness uniformity  $\leq \pm 3\%$
- 蒸着最高使用温度 450℃  
Evaporation temperature MAX450℃
- 有機3源共蒸着が可能  
Up to 3 Organic Co-evaporation available